3

@日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭63-59101

@Int.Cl.4

識別記号

广内整理番号

母公開 昭和63年(1988)3月15日

H 01 P 1/00 H 01 P 1/30 5/02 Z-7741-5J Z-7741-5J Z-8626-5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

分発明の名称

マイクロ波回路接続装置

②特 質 昭61-202218

登出 顧 昭61(1986)8月28日

砂発明者 目片

強 司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

の出願。人 松下電器産業株式会社 の代理。人 弁理士中尾 敏男

外1名

明細 智

1、発明の名称

マイクロ故国路接続装置

2、特許請求の範囲

(1) 第1のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ海体の先端と、第2のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ海体の先端におおよ
そ4分の1波及の長さのインタデジタル結合回路
を形成し、第1のマイクロストリップ線路と第2
のマイクロストリップ線路の間に間段をもうけた
ことを特徴とするマイクロ波回路接続接置。

(2) 第1のマイクロストリップ線路と第2のマイクロストリップ線路の間筋に弾力性のある誘定体を挿入したことを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載のマイクロ波回路接続装置。

(3) 第1のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ線路のマイクロストリップ はなる、弾力性のある 導電性の物質で接続したことを特徴とする特許請求の心図が1項記載もしくは第2項記載のマイクロ波回

路接続装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は別々の基板上に構成された複数のマイクロ被回路を接続するマイクロ被回路接続接続に 関するものである。

従来の技術

第6図はとの従来のマイクロ波回路袋税装置の 平面図むよび側面図を示すものであり、13は接 地球休1は第1のセラミック装板、2は第2の ラミック装板、3はマイクロストリップが休休、4 はマイクロストリップが休である。6は、マイク ロストリップが休3かよびマイクロストリップが 休4とほぼ同等の紹をもつ網箱であり、マイクロストリップが休4とほぼの等の紹をもつ網箱であり、マイクロストリップが休4とほどでイクロストリップが休4にハンダ付けされている。6は基板1と基板2 との間覧である。

以上のように構成されたマイクロ波国路接続装 位にかいては、マイクロストリップ34体3より伝 送された信号は銅箔8を径てマイクロストリップ

特開昭63-59101(2)

線路4K伝達する。

発明が解決 しようとする問題点

しかしながら上記のような構成では、マイクロ 故 国路接続装置会体を温度変化の改しい場所に な でした場合、基板 1 , 基板 2 のそれぞれの 區度 さ 化による 都 没 もしく は 収 給 により 間隙 6 の大きさ イクロストリップ 導体 3 またはマイクロストリップ 導体 4 より は がれ 接続不良が生ずるという 節 5 へと り 前 5 なと い り 前 5 なと い り か 5 へ 2 が 4 と り は な 5 ないとい 5 ホンダ け し なくて は な 5 ないとい 5 第 2 の 間 類点を 有 し て い た。

本発明はかかる点に無み、温度変化の激しい場所に放配した場合でも高周故的に接続不良が生じず、しかも従来より少ない工数で組み立て可能なマイクロ放回路接続装置を提供することを目的とする。

問題点を解決するための手段

本発明は、異なった基板上にあるマイクロスト

政的に結合する結合導体部であり、10はマイクロストリップ導体4の結合導体部9に電磁的に結合では結合する結合導体部のと10はインタデジタル結合回路12を形成し使用周波数の4分の1波及の長さを有し、間隔のはインタディジタル結合回路12のインピダンスがマイクロストリップ等体3かよびマイクロストリップ等体4に近くなるように設定する。13は接地等体である。

以上のように構成された新1図の実施例のマイクロ被回路級被装置について、以下その動作を設明する。マイクロストリップ導体3に高回の設定が印加されると、インタディジタル結合回路12を介して、マイクロストリップ導体4に高速では、マイクロストリップ導体3とマイクロストリップ導体3とマイクロストリップ等体4を扱いので、セラミックを扱いので、セラミックが扱いので、セラミックが扱いので、セラミックが設定した場合でもこの装置が破損することはない。

作用

本発明は、異なった基板上にあるマイクロスト リップ線路を電磁的な結合を利用して接続すると とで基板間に関度を設け、温度変化による基板の ・ 膨張中収縮による関路接続部分の破損をさける。

実 簿 例

第1図a, bは本発明の第1の実施例にかけるマイクロ波回路接続装置の平面図および側面にのであり、第6図と同一物でついて、ったのであり、第6図と同一物でついて、ったのであり、第6図と同一物で、3,4はそのである。1は年7クロストリップ海体、6はを変えの凸部である。9はマイクロストリップ海体3の9ちマイクロストリップ海体4に世

以上のように、本実施例によれば、別々の基板上にあるマイクロストリップ導体3の先端とマイクロストリップ導体の先端とでインタデジタル結合回路12を形成し基板間に間隙を設けることにより、高周波結合特性は維持し、単純な構造で温度変化により破損しない、しかも、直流遮断機能を有するマイクロ被接続回路を得る。

第2図。, b は、本発明の第2の実施例におけるマイクロ被回路接続接置の平面図と側面図と側面図とのであり、第1図、第6図と同一物についいでは、第1回一番号を付して説明する。結合は中かとして説明する。結合は中かとし、が多なないのが、であるとして、マイクロストリップはよるのか半分とし、マイクロストリップはよるとに配置した。1図に示した第1の実施例と同様な使める。

以上のように構成された第2の実箔 内のマイクロ 版回路接続装置について、以下その動作を説明 する。マイクロストリップ海体3に高周故信号が 印加されると、結合羽体部9とからなるインメデ

特別町63-59101(3)

ジタル結合国路 1 2が電磁的に結合してマイクロストリップ海体 4 に高周波信号が伝達する。以上のような構成では、マイクロストリップ海体 8 を設破的に接続しないで、セラミック基板 1 シよびセラミック基板 2 が高度変化により膨張もしくは収縮した場合でもな数値が破損することがない。しかも、マイクロストリップ海体 3 とマイクロストリップ海体 4 を直線上に配置したため、狭い場所に構成可能となる。

以上のように、本実施例によれば、別々の藝板上にあるマイクロストリップ導体3とマイクロストリップ導体3とマイクロストリップ導体4の先端を狭めて、それぞれの狭めた結合導体部9,10で長さ4分の1放長のインタブンタル結合回路を設けることにより、単純な構造で、温度変化により破損しない、しか6、直旋遮断機能を有する小型のマイクロ被接続回路を得る。

第3図は、本発明の第3の実施例におけるマイクロ放回路接続装置の平面図を示すものであり、

クロ被回路接続装置について、以下その動作を認明する。マイクロストリップ導体3に高周波信号が印加されると、結合導体部の4.9 b かよび10 が電磁的に結合してマイクロストリップ導体4に 高周波信号が伝達する。以上のような構成では、マイクロストリップ導体3とマイクロストリップ等体3とマイクロストリップ等体1をでしたいので、セラミック差板1かよびセラミック差板2が風度変化により影破もしくは収縮した場合でも、本装置が破損するととはない。

以上のように、この実施例によれば別々の基板上のマイクロストリップ導体3とマイクロストリップ導体4にそれぞれ凹部でと凸部8を設け係合させてインタデジタル結合回路12を設けてマイクロストリップ導体3とマイクロストリップ導体4を高周故で導通させ、セラミック基板1とセラミック基板2の間に関係8をもうけることにより、温度変化により設切しないマイクロ波接続回路を得る。

第4図は、本発明の第4の契施例におけるマイ

第1図,第2図,第6図と同一物については同一 番号を付して説明をする。1は前1のセラミック 遊板、2は第2のセラミック遊板、3と4はそれ ぞれマイクロストリップ導体、6はセラミック基 板1とセラミック芸板2の間隙、7はセラミック **菇板1の四部、8はセラミック茶板2の凸部であ** り、四部でと凸部8は係合可能な形状とする。凹 部で、凸部8はそれぞれマイクロストリップ讲体 3 からびマイクロストリップ導体 4 上に機成され る。日1,9bはマイクロストリップ導体3のう ちマイタロストリップ練路4に電磁的に結合する 結合導体部であり、10はマイクロストリップ線 路4のりち、結合海体部9に電磁的に結合する部 分である。結合導体部9a,9bゃよび10は使 用する周波数の4分の1放長の長さのインタデジ ダル結合回路12で、間隙6はインタディジタル 結合回路12のインビザンスがマイクロストリッ プ導体3ヤマイクロストリップ導体4のインピー **メンスになるべく近くなるように設定する。**

以上のように構成された第3図の実施例のマイ

クロ波回路接続装置の平面図を示すものであり、 第1図、第2図、第3図、第6図と同一物につい では同一番号を付して説明する。マイクロストリ ップ等体3とマイクロストリップ等体4の間を弾 力性と高特性インピーダンスを有するポンディン グワイヤ11をたわませて接続するという点以外 は、第3図に示した第3の実施例と同様を構成で ある。

特別的63-59101(4)

化により起張もしくは収縮した場合でも、ポンディングワイヤ11は柔軟性を有し、たわませてあるので、間隙のが変化しても切断したりマイクロストリップ線路3またはストリップ線路4からはがれたりしない。また、高周波成分は、結合単体部94,86分よび10からなるインタデジタル結合回路12により基板の配張や収縮に関係なくマイクロストリップ讲体4に伝達する。

・以上のように、本実施例によれば別々のセラミック基板上のマイクロストリップ線路3とマイクロストリップ線路3とマイクロストリップ線路を電磁的に結合させ、さらに、たわませたボンディングワイヤ11で接続することにより、高周彼以外に返旋電流を伝送でき、しかも、温度変化による破損を生じないマイクロ彼回路接続装置を得る。

第6図は、本発明の第6の実施例におけるマイクロ故回路接続装置の平面図を示すものであり、第1図、第2図、第3図、第4図、第6図と同一物については同一番号を付して説明する。セラミ

ブ導体 4 とのインピーダンス整合をとることができ、通過損失の低減が容易となる。

以上のように、本実施例によれば、インタデジ メル回路の関係に誘電体を挿入することにより高 性能でしかも温度変化による劣化を生じないマイ クロ被回路接続装置を得ることができる。

なお、部1、第2、第3、第4、第6の突施例において、セラミック基板1とセラミック基板2とは、テフロン基板でも、また、その他の高周は日路用基板でもよいし、それぞれを別の材質としてもよい。第1、第2、第3、第4、第6の実施例において、マイクロストリップ呼休3とマイクロストリップ呼休4は同じ線路幅でもよい。また、第5の実施例で誘電でもよい。また、第5の実施例で誘電体14を間険全体に挿入したが、インタディジタル結合回路12の間隙だけでもよい。

発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、高周波 透過特性を損なわずに、温度変化によって破損を 生じないマイクロ破回路接続装置を得ることがで ック基板1とセラミック基板2の間隙8に斜線で示示した弾力性を有する誘電体14を挿入した点以外は第3回に示した第3の突施例と同様な構成である。

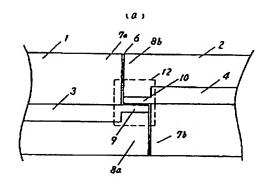
以上のように構成された第5の実施例のマイク ロ波回路接続装置について、以下その動作を説明 する。マイクロスドリップ線路3に高周波信号が 印加され、結合導体部8a.9b♪よび10から なるインタデジタル結合回路12を流じてマイク ロストリップ専体4に高周波信号が伝達する。誘 選体14はインタデジタル給合回路のインピーダ ンスをマイクロストリップ導体3とマイクロスト リップ導体4Kより正確に整合するのに用いる。 以上のよりな構成では、セラミック基板1かよび セラミック基板でが温度変化により超張もしくは 収縮した場合、間隙 6 の変化に応じて移電体 1 4 がその弾性により厚みを変化させ、破損すること はない。しかも、誘弦体11の誘定率で厚みを調 **塾することで容易にインタデジタル結合回路のマ** イクロストリップ海体3およびマイクロストリッ

き、しかも、直旋遮断効果を有し、また、場合に よってはポンディング等により直流を伝導できる 構造にすることもでき、その実用的効果は大きい。 4、図面の簡単な観明

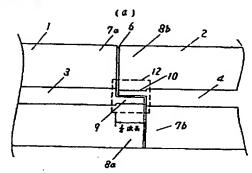
第1図は本発明の一実施例におけるマイクロ故 回路接続装置の平面図、および個面図、第2図は 同他の実施例におけるマイクロ故回路接続装置の 平面図および側面図、第3図,第4図,第5図は それぞれ同他の実施例におけるマイクロ故回路接 続装置の平面図、第6図は従来例におけるマイク ロ故回路接続装置の平面図および側面図である。 1,2……セラミック基板、3,4……間隙、12 ロストリップ呼体、5……網箱、6……間隙、12 ・・・・インタディジタル結合回路、14……誘電体。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 紋 男 ほか1名

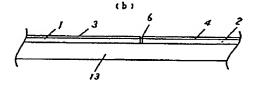
特開昭63-59101 (5)

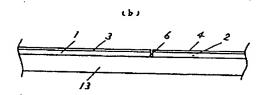
A 1 12



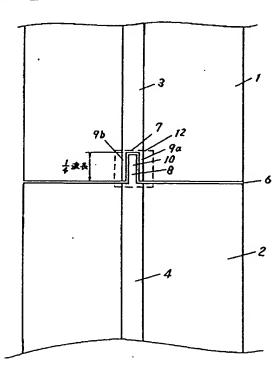




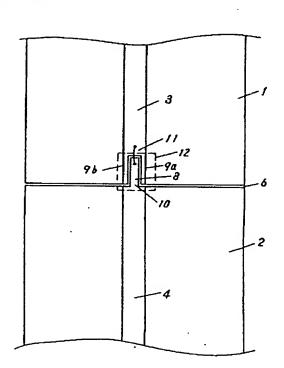




第 3 🗵

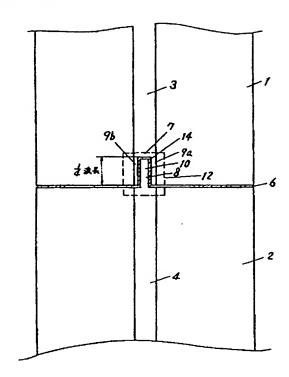


第 4 20



特開昭63-59101(6)

26 5 D21



3 6 62

